

(様式1)

委員会委員公募案内

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	多様化するレーザープロセッシングとその応用 調査専門委員会 (C部門) 【光・量子デバイス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の概要、委員長のメッセージ等 (100字程度)
設置期間	2026年3月～2028年2月 (令和8年3月～令和10年2月)	本委員会では、レーザー加工分野の研究者・企業・装置開発者が分野横断で連携し、最新成果の共有や産官学共同研究、人材育成を推進するとともに、AI活用や国際交流を通じ日本のレーザー加工技術に関する競争力向上を目指している。
委員長名(所属)	花田 修賢(弘前大学)	
委員会開催頻度	3回/年	
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名(所属) 花田 修賢 (弘前大学) E-mailアドレス y-hanada@hirosaki-u.ac.jp	
応募いただきたい方の 専門分野、経験など	レーザープロセッシングに関する基礎及び応用研究に従事または興味を持っている方。電気学会の会員の方、もしくは入会予定の方が望ましい。	
応募締切	随時	
協同研究委員会の場合の委員の負担		円/年